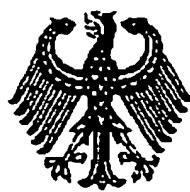


BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



Prioritätsbescheinigung DE 101 23 725.1 über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen: 101 23 725.1

Anmeldetag: 15. Mai 2001

Anmelder/Inhaber: Carl Zeiss SMT AG, 73447 Oberkochen/DE

Erstanmelder:
Fa. Carl Zeiss, 89518 Heidenheim/DE

Bezeichnung: Projektionsbelichtungsanlage der Mikrolithographie,
Optisches System und Herstellverfahren

IPC: G 03 F, G 02 B

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 12. Juli 2006
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag

Kahle